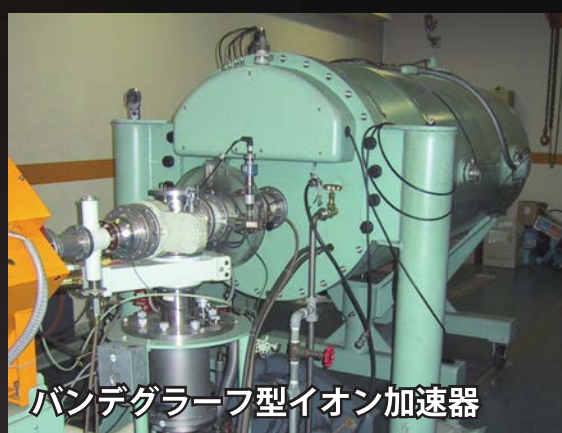




RBSビームライン



タンデム型高エネルギーイオン注入装置



バンデグラーフ型イオン加速器

第44回 法政大学

イオンビーム工学研究所シンポジウム

THE 44th SYMPOSIUM ON MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
RESEARCH CENTER OF ION BEAM TECHNOLOGY, HOSEI UNIVERSITY

日時 2025年12月10日(水)

会場 法政大学小金井キャンパス

招待講演：現地及びオンライン

一般講演(ポスター)：現地

(JR中央線東小金井駅下車徒歩12分)

詳細 <https://www.hosei.ac.jp/ionbeam/katsudo/>



● 招待講演 ●

「ダイヤモンド半導体へ室温イオン注入したドーパントP原子の新しいアニール手法によるN型電氣的活性化 -MeV 級イオン照射による新しいアニール手法の導入-」

中田 穰治 神奈川大学名誉教授

「学生に送る 研究者としての人生で運がドンドン良くなる方法

-化合物半導体の研究・開発の経験から-」

三島 友義 元法政大学教授／大阪大学招聘教授

● 一般講演募集 ●

- 生体微量元素分析技術 ●ナノテクノロジー材料の創製
- 次世代エレクトロニクス材料 ●新材料のプラズマプロセス
- 分析技術

など、イオンビーム技術と関連材料技術について募集します。

予稿締切 2025年11月7日(金)

● 参加費 ●

無料(予稿集は当日現地にて配布します。Proceedings 冊子は講演者及び希望者に後日郵送します。)

● 主催・問い合わせ先 ●

法政大学イオンビーム工学研究所

〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2

TEL 042-387-6094, FAX 042-387-6095

E-Mail ion-sympo@ml.hosei.ac.jp

● 協賛 ●

日本物理学会、応用物理学会、日本アイソトープ協会



イオンビーム工学研究所